

第15回国際マイクロマシン・ナノテクシンポジウム-MEMS World- プログラム(案)

「集積化・融合化の進むMEMS/ナノデバイス 産業化のブレークスルー」 ～研究開発拠点の集約化とMEMSアプリケーション～

2009年7月29日(水) 「第20回マイクロマシン/MEMS展」会場内 特設会場A

司会: 独立行政法人 産業技術総合研究所
先進プロセス製造研究部門 主幹研究員 前田 龍太郎

オープニング		
10:30 ~ 10:35	開催挨拶	(財)マイクロマシンセンター 理事長 野間口 有
10:35 ~ 10:40	来賓挨拶	経済産業省 製造産業局 産業機械課長 米村 猛

基調講演 最先端研究所へのMEMS研究開発の集約化		
10:40 ~ 11:10	フランスにおけるMEMS Leti/MINATECのR&Dモデルとビジョン	Leti Silicon Heterogenous Integration Dept. Andre Rouzaud
11:10 ~ 11:40	マイクロ・ナノへ向かう統合システム技術	Head of Fraunhofer ENAS (Research Institution for Electronic Nano Systems) Prof. Thomas Gessner
11:40 ~ 12:10	世界におけるMEMSの成長機会; MIGの展 望 米国におけるMEMSの動きと新技術	MEMS Industry Group Managing Director Karen Lightman
12:10 ~ 13:10	昼食	

セッション 1 MEMSが拓く新しい世界(アプリケーション)		
13:10 ~ 13:40	安全・安心のためのアニマルウォッチセン サの開発	(独)産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門 ネットワークMEMS研究グループ 研究グループ長 伊藤 寿浩
13:40 ~ 14:10	シリコン光変調器の実現技術	Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems Thilo Sandner
14:10 ~ 14:40	安全・安心・健康を目指したウェアラブルエ レクトロニクス	東京理科大学・総合研究機構 危機管理・安全科学技術研究部門長 教授 NPO ウェアラブル環境情報ネット推進機構理事長 板生 清
14:40 ~ 15:10	苛酷環境対応ワイヤレスMEMSセンサー エネルギーと発電への応用	UC Berkeley, BSAC Department of Mechanical Engineering Prof. and Chair Albert P. Pisano
15:10 ~ 15:20	休憩	

セッション2 開発現場のニーズに答える最新プロセス・ 材料技術動向		
15:20 ~ 15:45	SOIはMEMSにおける制約を打破できる か? ウエハーベンダーからの提案	Okmetic Oyj Senior Vice President, Research Markku Tilli
15:45 ~ 16:10	Chip to Wafer接合の最新技術と今後の展 望	EVGroup Director of Technology, Technology Div. Sunil Wickramanayaka
16:10 ~ 16:35	MEMS向けハーメチック実装設計 現状と今後の展望	SAES Getters S.p.A. Business Manager, Getter for MEMS Marco Moraja

クロージング		
16:35 ~ 16:45	閉会挨拶	(財)マイクロマシンセンター 専務理事 青柳桂一